

Stanowisko do wytwarzania i badań in situ nanostruktur sensorowych



Opis techniczny:

Technologiczno-pomiarowe stanowisko składające się z 5 niezależnych komór spełniających standardy ultra-wysokiej próżni (UHV) firmy PREVAC

Nazwa handlowa: Stanowisko do wytwarzania i badań in situ nanostruktur sensorowych

Więcej szczegółów: </equipment/stanowisko-do-wytwarzania-i-badan-in-situ-nanostru/>

Rodzaj dostępu: Zewnętrzna

Rodzaj akredytacji / certyfikatu: Nie dotyczy

Osoba kontaktowa: Zakrzewska Katarzyna

Osoba kontaktowa - adres strony www: <https://skos.agh.edu.pl/osoba/katarzyna-zakrzewska-3844.html>

Jednostka odpowiedzialna: Instytut Elektroniki

Grupa / laboratorium / zespół: Zintegrowane Laboratorium Nanostruktur Sensorowych, <http://www.zlns.agh.edu.pl/>

Data ostatniej aktualizacji: 29 sierpnia 2023 11:55

Rok wprowadzenia do użytkowania: 2019

Obszary badawcze IDUB:

(POB 4) Rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów. Zastosowania narzędzi matematyki, informatyki i elektroniki w problemach skali makro, mikro i nano

Możliwości badawcze:

Nanoszenie cienkich warstw metodą reaktywnego rozpylania magnetronowego

Możliwości pomiarowe:

Pomiary in-situ metodą sondy Kelvina i rezystancyjnej sondy czteropunktowej

Warunki udostępniania infrastruktury:

Do uzgodnienia z Kierownikiem Laboratorium ZLNS